06;08

## Прямое наблюдение релаксации проводимости в $\gamma$ -облученном кремнии n-типа под влиянием импульсов ультразвука

© Я.М. Олих, Н.Д. Тимочко

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, Киев

E-mail: jaroluk3@ukr.net

Поступило в Редакцию 4 августа 2010 г.

В облученном и частично отожженном (280° C) n-Si-Fz в интервале температур  $T=110-180\,\mathrm{K}$  впервые обнаружено обратимое изменение электропроводимости  $\sigma_{\mathrm{US}}$  при импульсном ультразвуковом нагружении (продольные волны: частота  $6-10\,\mathrm{MHz}$ , интенсивность до  $4\cdot 10^3\,\mathrm{Wt\cdot m^{-2}}$ , длительность импульса  $10^{-5}-10^{-3}\,\mathrm{s}$ ). Установлено, что температурные зависимости акустоиндуцированных изменений  $\sigma_{\mathrm{US}}$  (времена нарастания —  $\tau_i$  и спада —  $\tau_d$ ) описываются уравнениями Аррениуса. Из наклона экспериментальных  $\tau_{i,d}(T)$  определены энергии активации соответствующих процессов  $U_i\approx 0.09\,\mathrm{eV},\ U_d\approx 0.13\,\mathrm{eV},\ \tau_i^0\approx 4\cdot 10^{-8}\,\mathrm{s},\ \tau_d^0\approx 10^{-9}\,\mathrm{s}$ . Наблюдаемый эффект интерпретирован как акустоиндуцированный переход метастабильного дефекта между его состояниями.

Многие дефекты в полупроводниках характеризуются би- и метастабильным характером поведения [1–3]. Интерес к метастабильным дефектам (МД) с практической точки зрения обусловлен возможностью управления физическими параметрами полупроводниковых приборов за счет обратимой перестройки подобных комплексов, в частности использования явления бистабильности для создания ячеек памяти нового поколения. Благодаря интенсивным исследованиям с применением электронного парамагнитного резонанса, инфракрасной спектроскопии, нестационарной емкостной спектроскопии и других методик наблюдается значительный прогресс в понимании механизма метастабильности. Было показано, что процессы перестройки атомной конфигурации дефекта и изменение его зарядового состояния часто взаимосвязаны и происходят комплексно. Причиной таких процессов могут быть локаль-

ная деформация, изменение температуры, электромагнитное поле, радиация, а также ультразвук (УЗ) [4-6]. При исследовании возможностей практического применения УЗ для управления структурой дефектов в полупроводниковых кристаллах получен целый ряд экспериментальных результатов. Например, обработка УЗ стимулирует распад [4] и образование [5] различных комплексов, перегруппировку дефектов [6,7], формирование наночастиц [8]. Основной механизм акустоиндуцированных (АИ) изменений характеристик материала в бездислокационных кристаллах, по нашему мнению, как раз и связан с метастабильным характером отдельных дефектных комплексов. Однако теория взаимодействия УЗ с МД пока отсутствует. Остается неизученной, в частности, и кинетика АИ-изменений электрофизических и фотоэлектрических параметров полупроводников, которая могла бы помочь уточнить механизм воздействия УЗ. Трудности таких исследований связаны с традиционным использованием волн УЗ в непрерывном режиме [4–10], что делает невозможным наблюдение быстрых переходных процессов. В данной работе впервые использован новый методический подход, который состоит в применении УЗ в форме прямоугольных имульсов, что позволяет наблюдать и исследовать динамические (in situ) изменения характеристик материала в процессе нагружения УЗ.

Исследовались образцы бездислокационного тигельного кремния n-типа проводимости n-Si-Fz: P; концентрация примесных атомов фосфора, кислорода и углерода составляла:  $N_{\rm P} \approx 4.8 \cdot 10^{19} \, {\rm m}^{-3}$ ,  $N_{\rm O} < 5 \cdot 10^{21} \, {\rm m}^{-3}, \, N_{\rm C} \approx 1.0 \cdot 10^{22} \, {\rm m}^{-3}$  соответственно. Акустоактивные дефекты, чувствительные к действию УЗ, создавались путем радиационного облучения  $\gamma$ -квантами  $^{60}$ Со-дозой  $\sim 10^8$  rad при комнатной температуре и дальнейшим специальным отжигом образцов до  $T=280^{\circ}\mathrm{C}$ (с шагом 40°C, длительностью 20 min). Предварительная подготовка обусловлена тем, что, как показано ранее [10], эффективность влияния УЗ в отожженных образцах по сравнению с неотожженными увеличивается. Измерения концентрации  $n_0$  и подвижности  $\mu_0$  электронов в образцах кремния проводились методом эффекта Холла в температурном диапазоне 100-300 К на стандартных прямоугольных образцах в режиме постоянного тока  $I_0 \sim 10^{-6} {
m A}$  и постоянного магнитного поля  $B = 0.45 \,\mathrm{T}$ . Волна УЗ распространялась вдоль толщины образца 0.45 Т параллельно кристаллографическому направлению (110). Для измерений температурных холловских зависимостей электрофизических параметров использовался азотный криостат, оснащенный акустически-

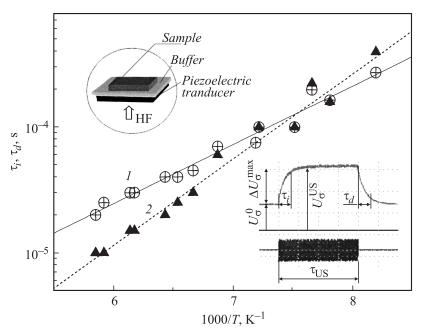
ми элементами [11]. Такая дополнительная оснастка позволяет реализовать возможность последовательных измерений на одном образце при различном состоянии структуры дефектов как в исходном, так и в акустически возмущенном состоянии соответственно. Генерация УЗ производилась с помощью пьезоэлектрического преобразователя — пластины ниобата лития  $(Y+36^\circ)$ -среза, на которую подавался синусоидальный сигнал от генератора ВЧ. Как было установлено ранее, проводимость  $\sigma_0 = e n_0 \mu_0$   $\gamma$ -облученных образцов n-Si-Fz: Р в интервале 100-200 К определяется глубокими акцепторными уровнями в запрещенной зоне с энергией  $E_c-0.23$  eV [9]. При нагружении УЗ в непрерывном режиме в диапазоне температур T<200 К наклон зависимости  $n_{\rm US}(T)$  несколько увеличивается, а концентрация свободных электронов  $n_{\rm US}^{-1}$  уменьшается, т.е. наблюдается АИ-изменение  $\Delta n = n_0 - n_{\rm US}$ . После выключения действия УЗ  $\sigma_{\rm US}$  возвращается в исходное состояние [10].

При исследовании в данной работе кинетики акустопроводимости  $\sigma_{\rm US}$  частично отожженных (280°C) образцов n-Si-Fz использовался импульсный режим УЗ (несущая частота  $f_{\rm US} = 5-10\,{\rm MHz}$ , частота повторения импульсов  $F_i = 400 \,\mathrm{Hz}$ , длительность радиоимпульсов  $au_{\rm US} = 10^5 - 10^{-3}\,{\rm s}$  и их амплитуда  $V_{\rm US}$  — до 20 V). В этом варианте на цифровой осциллограф, синхронизированный импульсами ВЧ, с потенциальных контактов образца подается измеряемое напряжение  $U_{\sigma}^{\rm US} = kI_0/\sigma_{\rm US}$  (коэффициент k определяется размерами образца). При определенных экспериментальных условиях (см. ниже) в случае проявления эффекта акустопроводимости на фоне постоянной компоненты  $U_{\sigma}$  наблюдается "импульс  $\Delta U_{\sigma}$ ", соответствующий АИ-уменьшению  $\sigma_{\mathrm{US}}$ (см. осциллограмму на рис. 1). Оказалось, что фронты этого "импульса  $\Delta U_{\sigma}$ ", определяющиеся продолжительностью нарастания  $\tau_i$  и спада  $\tau_d$ АИ-изменений  $\sigma_{\rm US}$ , значительно превосходят длительность фронтов импульса ВЧ и при постоянной температуре удовлетворительно описываются экспоненциональными зависимостями (1) и (2) соответственно:

$$\Delta U_{\sigma}^{i}(t) = \Delta U_{\sigma}^{\max} (1 - \exp(-t/\tau_{i})), \tag{1}$$

$$\Delta U_{\sigma}^{d}(t) = \Delta U_{\sigma}^{\text{max}} \exp(-t/\tau_{d}). \tag{2}$$

 $<sup>^1</sup>$  В дальнейшем физические величины, определяемые в условиях отсутствия влияния УЗ, будем обозначать нижним индексом "0", а найденные при нагружении УЗ — индексом "US".

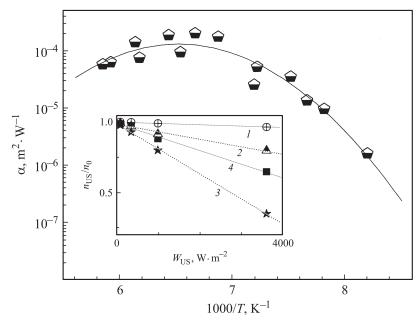


**Рис. 1.** Температурные зависимости времен релаксации: I — нарастания  $\tau_i$ ; 2 — спада  $\tau_d$ . Точки — эксперимент, сплошные линии — аппроксимация в соответствии с (3). Вставки: вверху в кругу выделен акустический узел — пьезоэлектрический преобразователь, акустический буфер и образец; внизу осциллограммы "импульса  $\Delta U_\sigma$ " на образце и импульса ВЧ на пьезопреобразователе.

Температурные исследования "импульса  $\Delta U_{\sigma}$ ", проведенные при постоянной  $W_{\rm US}\approx 4\cdot 10^3{\rm Wt\cdot m^{-2}}$  (интенсивность УЗ в импульсе  $W_{\rm US}=c(V_{\rm US})^2$ ; параметр c определяется экспериментально), показали, что зависимости  $\tau_i(T)$  и  $\tau_d(T)$  являются термоактивированными, т. е. описываются в координатах Аррениуса:

$$\tau_{i,d}(T) = \tau_{i,d}^0 \exp(E_{i,d}/kT), \tag{3}$$

где  $E_{i,d}$  — энергии активации соответствующих процессов. Аппроксимация экспериментальных данных  $t_{i,d}(T)$  в соответствии с (3)



**Рис. 2.** Температурная зависимость коэффициента эффективности воздействия УЗ  $\alpha$ . На вставке амплитудные характеристики относительных изменений концентрации электронов при разных T, K: I — 128; 2 — 133; 3 — 142; 4 — 163.

(рис. 1) позволила определить значения величин  $E_i \approx 0.09 \pm 0.01$  eV,  $E_d \approx 0.13 \pm 0.01$  eV и  $\tau_i^{~0} \approx 4 \cdot 10^{-8}$  s,  $\tau_d^{~0} \approx 10^{-9}$  s.

В работе исследованы также амплитудные характеристики  $\Delta U_{\sigma}==f\left(W_{\mathrm{US}}\right)$ . Учитывая, что при фиксированной температуре  $U_{\sigma}^{0}==kI_{0}/en_{0}\mu_{0}$  и  $U_{\sigma}^{\mathrm{US}}=kI_{0}/en_{\mathrm{US}}\mu_{\mathrm{US}}$ , рассчитаны относительные АИ-изменения концентрации свободных электронов в образце  $(n_{\mathrm{US}}/n_{0})==(U_{\sigma}^{0}/U_{\sigma}^{\mathrm{US}})$ . При расчете, в соответствии с предыдущими нашими экспериментами [9,10], полагалось, что  $\mu_{\mathrm{US}}(T)\approx\mu_{0}(T)$ . Действительно, в области температур  $T>125\,\mathrm{K}$  рассеяние электронов определяется колебаниями решетки, и их подвижность практически не зависит от УЗ. Как видно на рис. 2 (вставка), при всех температурах величина "импульсных" АИ-изменений концентрации электронов проводимости

 $\Delta n_{
m US} = (n_0 - n_{
m US})$  прямо пропорциональна  $W_{
m US}$ :

$$n_{\rm US}/n_0 = 1 - \alpha W_{\rm US},\tag{4}$$

где коэффициент пропорциональности  $\alpha$ , характеризующий эффективность воздействия УЗ, также зависит от температуры (рис. 2). Отметим здесь, что максимальное АИ-изменение  $\Delta n^{\rm max} \approx 2 \cdot 10^{18} \, {\rm m}^{-3}$  достигается при  $T \approx 150 \, {\rm K}$ .

В заключение рассмотрения экспериментальных результатов дополнительно отметим следующие установленные факты: 1) АИ-эффекты не связаны с тепловым воздействием — максимальный разогрев УЗ образца при импульсных нагружениях  $< 0.1\,\mathrm{K};\ 2)$  влияние магнитного поля на  $\Delta U_\sigma$  не обнаружено; 3) новые дефекты в результате нагружений УЗ как в непрерывном, так и в импульсном режимах не образуются (эффекты обратимы), микроструктура образца не изменяется.

Вопрос идентификации акустоактивного центра  $(C_s-C_i, P_s-C_i, P_s-C_i)$ , дивакансионные дефекты), обнаруженного в  $\gamma$ -облученных и частично отожженных образцах n-Si-Fz, остается открытым, и для выяснения механизма АИ-переходов потребуются дальнейшие исследования. Наиболее важным результатом работы является впервые наблюдаемый в режиме реального времени (in situ) процесс акустоиндуцированного обратимого перехода дефектной системы полупроводникового кристалла в возбужденное состояние. Это открывает дополнительные возоможности как для изучения акустоактивных дефектов в полупроводниковых материалах, так и для разработки импульсных акустоуправляемых устройств.

Авторы благодарят В.М. Бабича за предоставленные для исследований образцы кремния.

## Список литературы

- Song L.W., Zhan X.D., Benson B.W. et al. // Phys. Rev. B. Condensed Matter. 1990. V. 42. N 9. P. 5765–5783.
- [2] Вавилов В.С., Киселев В.Ф., Мукашев Б.Н. Дефекты в кремнии. М.: Наука, 1990. 216 с.
- [3] Мукашев Б.Н., Абдуллин Х.А., Горелкинский Ю.В. // УФН. 2000. Т. 170. В. 2. С. 143–155.
- [4] Подолян А.А., Хиврич В.И. // Письма в ЖТФ. 2005. Т. 31. В. 10. С. 11–16.
- $6^*$  Письма в ЖТФ, 2011, том 37, вып. 1

- [5] *Парчинский П.Б., Власов С.И., Лигай Л.Г.* // ФТП. 2006. Т. 40. В. 7. С. 829–832
- [6] Romanyuk B., Kladko V., Olikh Ya. et al. // Mater. Sci. in Semicond. Processing. 2005. V. 8. N 4. P. 171–175.
- [7]  $\textit{Onux O.H.} // \Phi T \Pi$ . 2009. T. 43. B. 6. C. 774–779.
- [8] Romanyuk A., Melnik V., Olikh Ya. et al. // J. Luminescence. 2010. V. 130. N 1. P. 87–91.
- [9] Олих Я.М., Тимочко Н.Д., Долголенко А.П. // Письма в ЖТФ. 2006. Т. 32. В. 13. С. 67–73.
- [10] Babych V.M., Olikh Ja.M., Tymochko M.D. // SPQEO. 2009. V. 12. N 4. P. 375–378
- [11] Олих Я.М., Савкина Р.К. // УФЖ. 1997. Т. 42. № 11–12. С. 1385–1389.